سنتز نانوذرات اکسید قلع آلاییده شده با اتم های روی و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری آنها اسمعیل وندی، سمیه^۱ ؛ مرادیان، رستم^{۱ و۲}؛ منوچهری، ایرج^{۲۰۱} ؛ غلامی، کتایون^{۲و۲}

^ا گروه فیزیک ، دانشکاده علوم، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرمانشاه ۲ مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیدہ

در این پژوهش، نانوذرات اکسید قلع با تزریق درصد های مختلف ناخالصی روی به روش سل-ژل تهیه شدند. خواص ساختاری و بلورینگی نانوذرات با استفاده از طیف پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. و میانگین اندازه نانوذرات با استفاده از رابطه دبای- شرر محاسبه گردید. خواص اپتیکی نانوساختارهای تهیه شده با طیف سنجی مرئی- فرابنفش بررسی شد و ریخت شناسی نانوذرات از تصاویر SEM تعیین گردید. نتایج نشان داد که تغییر درصد ناخالصی روی، بطور قابل توجهی بر ساختار، اندازه، مورفولوژی و خواص نوری نانوذرات تاثیر دارد. بطوریکه مقدار گاف را از ۲۹۳ الکترون ولت تا

Synthesis Of Tin Oxide Nanostructures Doped With Zinc Atoms; Investigation Of Their Optical And Structural Properties

Esmaeilvandi, Somayeh¹; Moradian, Rostam^{1,2}; Manocheri, Iraj^{1,2}; Gholami, Katauon^{1,2}

¹ Department of Physics, Facultry of science, Razi university, Kermanshah ² Nanoscience and Nanotechnology Research Center, Razi university, Kermanshah

Abstract

In this researche, Tin oxide nanoparticles doped with different percentages zn injections were prepared by solgel method. The Structural properties and crystallinity of the nanoparticles were studied using X-ray diffraction (XRD). The mean particles size was calculated using Debye-Scherer equation. Optical properties of the prepared nanostructures have been investgeted using ultraviolet-visible (UV-ViS) spectroscopies And morphology of nanoparticles was determined from SEM images. The results showed that Change percentage of impurities zn significantly influenced on the microstructure, size, morphology and optical property of the SnO_2 produts. As the gap from 93/3 to 71/3 eV reduced electron volts.

PACS No.

بدلیل داشتن خواصی همچون انرژی گاف عریض و مستقیم(۳/۶eV) در دمای اتاق، شفافیت بالای الکتریکی، پایداری گرمایی و مکانیکی، رسانندگی بالا، رفتار پیزوالکتریکی و همچنین غیر سمی و ارزان قیمت بودن بسیار مورد توجه است. اکسید قلع در ساخت بازتاب کننده های گرمایی در سلولهای خورشیدی [۲]، دستگاه های اپتوالکترونیکی و کاتالیست ها [۳] بکار برده می شود. همچنین گاف انرژی مستقیم و بزرگ و قابلیت آلاییدگی با

گستره ی وسیع خواص شیمیایی و الکترونیکی اکسیدهای فلزی، آنها را به ابزار مناسبی برای تحقیقات پایهای و کاربردهای تکنولوژی تبدیل کرده است. اخیرا تزریق ناخالصی به نانوساختارهای نیمرسانا، مسیری موفق جهت تحقیق و بررسی اثر اصلاح کنندگی ناخالصی ها بر خواص اپتیکی، الکتریکی و معناطیسی نانوساختارها گشوده است [۱]. اکسید فلزی SnO2

بسیاری از مواد باعث شده است که اکسید قلع برای استفاده در حسگرهای گازی مناسب باشد [۴]. روشهای سنتز در تعیین ریخت شناسی نانوذرات موثر است، ازجمله روشهای ساخت نانو ذرات اکسید قلع: سل-ژل [۵]، تبخیر شیمیایی [۶] و هیدروترمال [۷] است. در میان این روشها روش سل-ژل به دلیل خلوص بالا، همگن بودن، اندازه کوچک ذرات تولیدشده و همچنین ارزان بودن و توانایی در کنترل اندازه ذرات مناسبتر است. در این پژوهش نانو ذرات اکسید قلع آلاییده شده با اتم روی به روش سل-ژل ساختهشدند و در دمای C ° ۰۶۰ ساختارهای بلوری نانوذرات تهیه شدند.

مواد و روش تحقیق

نانوذرات اکسید قلع آلاییده شده با اتم روی با فرآیند سل-ژل تهیه شدند. بطوریکه ابتدا مقدار ۶ گرم SnCl₂ .2H₂O در ۱۰۰ میلی لیتر آب دی یونیزه حل گردید. سپس برای جلوگیری از هیدرولیز سريع قلع به محلول ۲ ميلي ليتر اسيد كلريد اضافه شد. بعد از آماده سازی محلول آنرا بر روی همزن مغناطیسی قرار داده و ۳ میلی لیتر محلول آمونیاک را بصورت قطره قطره به آن اضافه می شود. بلافاصله بعد از اضافه شدن آمونیاک رسوب سفید رنگی در ظرف محلول تشکیل میشود. محلول ها را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای [°]C و پایدار می شوند. سپس مقادیر متفاوت از ناخالصی Zn(CH₃COO)₂.2H₂O که در ۱۰ میلی لیتر آب مقطر حل شده، آرام آرام به محلول اولیه اضافه می شود. بدین ترتیب درصد های مختلف از اکسید قلع آلاییده شده با ناخالصی روی بدست می آیند. پس از افزودن محلول ناخالصی، به مدت ۲ساعت محلول نهایی در همان دما روی همزن مغناطیسی به هم زدن ادامه می دهد. به منظور ته نشین شدن رسوب، محلول در دمای محیط به مدت ۲۴ ساعت قرار می گیرد. سپس رسوب را با آب مقطر شستشو داده و آن را در دمای $^\circ C$ ۱۰۰ به مدت یک ساعت در آون خشک می شود. سیس نمونه درون کوره به مدت ۲ ساعت در دمای C° ۶۰۰ پخت می شوند.

برای مشخصه یابی نمونه های بدست آمده از دستگاه XRD و برای تعیین طیف جذبی از دستگاه UV-VIS استفاده شد. و

همینطور به منظور بررسی ریخت شناسی نمونه ها از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شده.

نتايج و بحث

شکل ۱ طیف پراش پرتو ایکس برای نانوذرات اکسید قلع آلاییده شده با اتم روی کـه در دمـای [°] ۶۰۰ پخـت شـده انـد، آورده شده است. تمام قله های پراش در این شکل با ساختار روتیل تتراگونال در کارت استاندارد شماره (JCPDS Card NO:) 71-0652) مطابقت خوبي دارد. براي نمونه هاي SnO₂ آلاييده شدہ با اتم روی ہیچ فاز ثانویہ (Zn or ZnO) مشاہدہ نشد کے این نشان از تبلور خالص و جانشینی روی در ساختار اکسید قلع است. همانطور که در شکل مشاهده می شود برای نمونه خالص اكسيد قلع و نمونه هاي آلاييده شده ساختار تتراگونال تشكيل شد. با افزایش درصد ناخالصی شدت قله ها کاهش و در بعضی از قله ها پهنای پیک در نصف مقدار بیشینه (FWHM) افزایش یافته است. این امر به دلیل تغییر ساختار بلوری SnO₂ می باشـد و بـه این معناست که حتی اگر یون Zn^{+2} بطور منظم در شبکه موقعیت Sn⁺⁴ را اشغال کند، باز هم این ناخالصی باعث تولید نقص در سرتاسر بلور می شود و عدم تعادل بار ناشی از ایـن نقـص سـبب تغيير استوكيومتري اين مواد است.



شکل ۱: طیف پراش پرتو x نمونه های اکسید قلع تهیه شده با غلظت های مختلف اتم روی

با استفاده از داده های XRD بدست آمده ثابت های شبکه نمونه خالص ۴/۷۳۸ و ۲/۱۸۸ ت آنگستروم و نمونه آلاییده ۴/۷۳۷ ه و ۴/۷۳۵ ت آنگستروم اند. ثابت های شبکه نمونه آلاییده شده در مقایسه با ثابت های شبکه مرجع ۴/۷۴ و ۲/۱۹ ت کمی مقایسه با ثابت های شبکه مرجع ۴/۷۴ و ۲/۱۹ ت کمی کوچکتر شده اند. این کاهش به این دلیل است که اتم روی با شعاع یونی ۲/۶۰ آنگستروم به جای قلع با شعاع یونی ۶۹/۰ آنگستروم در شبکه جایگزین شده است. که این کاهش ثابت های شبکه سبب افزایش چگالی در سلول واحد نمونه می گردد. علاوه شبکه سبب افزایش چگالی در سلول واحد نمونه می گردد. علاوه بر این چگالی نانوذرات اکسید قلع خالص و آلاییده شده با اتم روی به ترتیب ۶/۹۹۵ gr/cm و ۶/۹۹۷ محاسبه شد، که نشان می دهد نانوذرات آلایده شده چگال تر از نانوذرات خالص شده اند. متوسط اندازه ذرات با فرمول دبای شرر بدست آمد:

$$D = \frac{0.9\lambda}{\beta Cos \theta} \tag{1}$$

که در آن λ طول موج پرتو ایکس، β پهنای پیک ماکزیمم در نصف ارتفاع آن و Θ زاویه پراکندگی است. متوسط اندازه محاسبه شده برای بلورک ها در جدول (۱) آمده است.

در شکل۲ بعنوان نمونه، آنالیز EDX نمونه ی ٪۲/۷۴ آمده است و نتایج مربوط به EDX نمونه ها در جدول شماره ۱ بیان شده است.



جدول ۱: متوسط سایز ذرات، درصد ناخالصی،انرژی گاف اکسید قلع آلاییـده شده با روی.

نمونه	متوسط	متوسط	درصد	انرژى
	سايز (nm)XRD(سايز SEM(nm)	ناخالصي	گاف(eV)
SnO ₂	۳.	11	•	r/areV
۲/۴۵%	47/77	34/29	۲/۴۵٪.	۳/VIeV
۲/۷۲٪.	00/41	$\Delta\Delta/V$ ·	۲/۷۲'/.	٣/vveV
۲/۷۴٪	01/41	۵•/۸۱	٢/٧۴٪.	٣/AVeV

یکی از مفیدترین روشها بهمنظور تحلیل نوری نانو ذرات، استفاده از طیفسنجی در ناحیه مرئی و فرابنفش امواج الکترومغناطیسی است. مشخصه های نوری نمونه ها از طیف های جذبی بدست آمد. طیف جذب نوری نمونه ها در شکل ۳ نشان داده شده است. همانطورکه در شکل مشاهده می شود با تزریق ناخالصی روی، جذب در ناحیه مرئی کاهش یافته است.



شكل٣: طيف جذب نانوذرات اكسيد قلع خالص و الاييده شده با اتم روي.



شکل ۴: نمودار گاف انرژی اپتیکی نانوذرات اکسید قلع خالص و آلاییده شده با اتم روی.

[۸] گاف انرژی اپتیکی مستقیم از رابطه ی: [۸]

$$\alpha h \upsilon = E_d (h \upsilon - E_g)^2$$
(۱)

قابل محاسبه است. در این رابطه α ضریب جذب، hv انرژی فوتون، E_s عددی ثابت و E_s گاف انرژی است. بنابراین گاف انرژی اپتیکی مستقیم با رسم نمودار (αhv) بر حسب انرژی فوتون به دست می آید. بطوریکه مقدار گاف انرژی اپتیکی از برون یابی این نمودار در 0 = hv مشخص می شود. شکل ۴ این نمودارها را برای تعیین گاف انرژی اپتیکی نانوذرات اکسید قلع در حضور ناخالصی روی، نشان می دهد و مقادیر آن در جدول ۱ ورده شده اند. با توجه به شکل گاف انرژی اپتیکی نانوذرات بدون حضور ناخالصی در حدود ۳/۹ الکترون ولت است که با تزریق ایتیکی نانوذرات بدون حضور ناخالصی در حدود ۳/۹ الکترون ولت است که با تزریق آندازی ایتیکی نانوذرات بدون منوا ایزی ایتیکی نانوذرات بدون حضور ناخالصی در حدود ۳/۹ این می دهد و مقادیر آن در جدول آندازی آندری ایتیکی نانوذرات بدون حضور ناخالصی در حدود ۳/۹ ایکترون ولت کاهش یافته است. این حاکی از منوازی آنست که با افزایش درصد ناخالصی و کاهش گاف انرژی، اندازه درات بدست آمده از درات افزایش می یابد که با نتایج میانگین اندازه ذرات بدست آمده از درات افزایش می یابد که با نتایج میانگین اندازه ذرات بدست

ریخت شناسی، توپو گرافی سطح و مشخصات ساختاری نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. شکل ۵ مربوط به نانو ساختارهای اکسید قلع بدون حضور ناخالصی و آلاییده شده با روی است. همان طور که در تصاویر مشخص است در نمونه های آلاییده شده، اتم روی بر مورفولوژی تأثیر داشته است و اندازه ذرات را بزرگتر کرده است. بطوریکه در جدول ۱ آورده شده است متوسط اندازه ذرات از ۱۱nm تا ۵۵۸۸ افزایش داشته است. متوسط اندازه ذرات در تصاویر SEM و محاسبه شده از طیف متوسط اندازه ذرات سبب کاهش مقادیر گاف انرژی اپتیکی در نمونه های آلاییده شده نسبت به نمونه ی بدون ناخالصی نیز شد.





شکل۵: (a) تصویر میکروسکوپ الکترونی اکسید قلع خالص، (b) نمونه آلاییده شده با غلظت ٪۲/۷۴

نتيجه گيرى

نانوذرات اکسید قلع آلاییده شده با اتم روی، بسادگی و در دمای پایین به روش سل-ژل تهیه شدند. طیف پراش اشعه ایکس نانوذرات رشد بلوری خوبی را در ساختار تتراگونال نشان داد. اندازه متوسط نمونه ها از تصاویر SEM و محاسبه شده از طیف XRD و رابطه ی دبای-شرر مطابقت خوبی داشتند. بطوریکه متوسط اندازه نانوذرات در محدوده ی ۵۵-۱۱ نانومتر بود و با افزایش درصد ناخالصی ذرات بزرگتر شدند. با تزریق ناخالصی روی، گاف انرژی اپتیکی نمونه ها نسبت به نمونه بدون ناخالصی کاهش داشت که ناشی از افزایش متوسط اندازه نانوذرات است. این رفتار با کاهش جذب در ناحیه ی مرئی در طیف جذبی از آنالیز UV-Vis نیز منطبق است.

مرجع ها

- [1] D. J. Norris, A. L. Efros, and S. C. Erwin, *Doped nanocrystals*, *Science*, **319**(2008), 1776.
- [Y] Gnanam, G., Rajendran, V., Preparation of Cd-doped SnO2
- nanoparticles by sol-gel route and their optical properties, *JSol-Gel Sci Technol*, Vol. **56**, pp. 128-133, 2010.
- [^r]Zhuang, S., Xu, X., Pang, Y., Li, H., Yu, B., Hu, J., Variation of structural, optical and magnetic properties with Co-doping in Sn1-
- xCoxO2nanoparticles, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. **327**, pp. 24-27, 2013.
-]4[Ansari S.G., Boroojerdian P., Sainkar S.R., "Grain Size Effects on H2Gas Sensitivity of Thick Film Resistor Using SnO2Nanoparticles", *Thin Solid Films*, Vol. **295**, pp. 2711 276, 1997.
- [] M.I.B. Bernardi, S. Cava, C.O. Paiva-Santos, E.R. Leite,
- C.A.Paskocimas, E. Longo, M. Bernardi, J. Eur. Ceram. Soc. 22, 2911(2002).
- [۶] H.Rinnert, P.Miska, M.Vergnat, G. Schmerber, S. Colis, A.Dinia, D.
 Muller, G. Ferblantier, A. Slaoui, *Appl. Phys.* Lett. 100,101908 (2012)
 [٧] J.R. Zhang, L. Gao, *Mater. Chem. Phys.* 87, 10 (2004).
- [A] J. I. Pankove, Optical Processes in Semiconductores (Dover Publications Inc., New York, 1971). P. 1971.